



紫外四轴刻蚀设备

UV 4-axis laser etching machine

设备采用紫外纳秒脉冲激光器作为加工光源，可实现大尺寸回转体表面、三维微曲面及二维平面的表面精密刻蚀。该设备在三维表面高效高精度刻蚀方面极具优势。

- 龙门式+转台机床结构，满足大尺寸回转体零件表面刻蚀，兼容三维微曲面及平面刻蚀需求；
- 具备机械轴+振镜三维五轴联动功能，保证刻蚀连续无拼接，高精度、高效率；
- 具备模型重构功能，通过测量模块与控制软件结合，实现三维零件模型仿真重构，无模型全工件仿真功能，适用于多种加工零件；
- 具备三维模型曲面插补及路径优化功能，能快速针对加工模型进行加工预处理；
- 具备防碰撞报警功能，保证加工过程中的安全性；
- 具备专用刻蚀软件，三维回转模型图像定位及平面图像测量，硬件/流程状态监控及权限配置功能。

主要技术参数	产品型号 GMC-A7060
机床行程(X/Y/Z轴) (mm)	800 / 700 / 500
(B轴) (°)	n×360
定位精度(X/Y/Z轴) (mm)	0.005 / 0.005 / 0.01
(B轴) (arc sec)	30
重复定位精度(X/Y/Z轴) (mm)	0.003 / 0.003 / 0.005
(B轴) (arc sec)	15
快移速度(X/Y/Z轴) (mm/s)	300 / 300 / 100
转速 (B轴) (rpm)	10
零件最大重量 (kg)	20
激光器平均功率 (w)	15
激光器脉冲宽度 (ns)	< 100
激光器输出波长 (nm)	355
工作台最大荷重 (kg)	30
设备重量 (kg)	5000
设备占地尺寸 (mm)	2000(宽)×2000(深)×2200(高)

